國立臺北科技大學分子系流變實驗室財產無償贈與清單 先進空氣極光處理設備(大氣電漿)

O	財產編號	序號	財產名稱	廠牌/型別	廠商名稱	數量	成本	現值	年限	取得日期	照片	尺寸/cm	經費來源
1	3101103-586	0000005	極光處理	大氣電漿/AP PLASMA ATM-23	大氣電漿	1	3,600,000	1,440,000	10	1080812	AP PLASMA	1300(L)** 186(W)* 170(H) ** 170(H) 村紹SS41和斷業等與機開關鍵安 對於實擠的人類與電電級示手關程盤全 與實際的一個的人類	教育部
	機器內部	FA					A size	TIME CE III		The state of the s			

機械手臂

攝影機

輸送帶

註:承接「先進空氣極光處理設備」(大氣電漿)的單位須自購空壓機及空氣乾燥機

工業電腦